



思达科技 晶圆参数量测探针卡测试论坛 Wafer Parametric Test (WAT) Probe Card Test Forum 论坛议程:

- 专注晶圆参数量测探针卡(WAT)探针卡·深入探讨探针卡在半导体工艺中的运用。
- 汇聚行业专家·推升晶圆参数量测探针卡(WAT)探针卡用户的技术和工作效率。
- 剖析前沿探针卡技术和创新的解决方案·共同研究未来的测试挑战。

(主办方保有议程调整权力)

Time 时间	Agenda 议程	Presented by 主讲人
13:00 - 13:20	Check-in 报到	
13:20 - 13:30	Opening 开场致词	陈信荣 Paul Chen STAR思达尔科技(武汉)总经理
13:30 - 14:10	晶圆参数量测(WAT)探针卡的关键验证和评估标准 WAT Key Qualification & Evaluation Criteria 技术知识点 Keypoint: ➢晶圆参数量测探针卡基础知识介绍 WAT probe card Basic knowledge introduction ➢思达科技探针卡性能验证程序 STAR Probe card performance qualification process ➢良好接触和标记的知识 Knowledge to make good contact and probe mark ➢解除测试问题的基本故障排除技巧 Fundamental trouble shooting skill to solve testing issues ➢在线清洁设置和定期保养维护的重要性 Importance of on-line clean setting and regular PM	简裕民 Yu-Ming Chien STAR思达科技 量测事业群总经理
14:10 - 14:50	探针卡管理和探针卡相关的晶圆参数量测问题 Probe Card Management and WAT Test Issues Related to Probe Card 技术知识点 Keypoint: ➢器件振荡问题 Device Oscillation Issue ➢探针卡管理功能:点触计数和警告 Probe Card Manage Function: Count the Contact and Warning ➢不同类型探针卡对验证(Cap)和泄漏电量测的影响 The Influence For Cap and Leakage Measurement with Different Types of Card	朱彬 Paul Zhu Keysight是德科技 半导体测试事业处 技术支持经理
14:50 - 15:30	高温探测经验分享 High temperature probing experience sharing 技术知识点 Keypoint: ➢高温测试的挑战 Challenges of High Temperature Testing ➢稳定高温测试的系统环境评估 System Environment Evaluation for Stable High Temperature Test ➢探针卡预热过程设置 Probe Card Warm Up Process Setting ➢思达探针卡的高温测试性能 STAR Probe Card Performance for High Temperature Test	林志豪 Chih-Hao Lin STAR思达科技 探针卡技术支持经理
15:30 - 15:50	Tea break 茶歇与技术交流	
15:50 - 16:30	实现晶圆参数量测和探针卡损坏预防的探针台要求 Prober Requirement for WAT Testing and Probe Card Damage Prevention 技术知识点 Keypoint: ➢晶圆参数量测探针台的特点和相关要求 WAT Prober Character and Relative Requirement ➢预防探针卡损坏功能 Probe Card Damage Prevention Function ➢东京电子新一代探针台@Prexa介绍 TEL New Prober @Prexa Introduce	钮永军 Yongjun Niu TEL东京电子 资深经理
16:30 - 17:10	次世代晶圆参数量测(WAT) MEMS工艺探针卡 New Generation WAT MEMS Probe Card 技术知识点 Keypoint: ➢思达科技MEMS工艺探针卡介绍和扩展 STAR MEMS Probe Card Introduction and Extensions ➢半导体晶圆测试研讨会(SWTEST)最具启发性的演讲 “用于大批量在线程序控制监测(PCM)和EOL晶圆参数量测(WAT)的先进MEMS探针卡” SWTEST Most Inspirational Presentation “Advanced MEMS Probe Cards for High-Volume Inline Process Control Monitoring (PCM) & End-of-Line Wafer Acceptance Tests (WAT)”	罗中 Daniel Lo STAR思达科技 探针卡研发部经理
17:10 - 17:20	Loucky Draw & Closing 闭幕致词	陈信荣 Paul Chen STAR思达尔科技(武汉)总经理